特許協力条約に基づく国際出願

国際出願番号	人业官庁記入欄	
国際出願日	<u></u>	
(受付印)		

顧書	国際出願日		
出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処 理されることを請求する。	(受付印)		
	出版人又は代理人の書項記号 (希望する場合、最大12字) FP1	6 5 S	
第1欄 発明の名称			
マスフローコントローラ			
	·		
第1個 出願人 この機に記載した者は、発明者でもある			
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び国名も記載)	紅紙番号:	
株式会社 エステック		075-693-2323	
STEC INC.		ファクシミリ番号: 075-693-2343	
〒601-8510 日本国京都府京都市南区吉祥院宮(		U/3-093-2343   加入電信番号:	
🖒 2, Miyanohigashicho, Kisshoin, Minami-ku, Kyol 1 Japan	to-sni, Kyoto 601-8510	加入电话证券。	
Supur		出順人登錄書号:	
国籍 (国名): B本国 JAPAN 住	E所 (国名): B本国 JAPAN		
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国	徐くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国	
第皿欄 その他の出願人又は発明者			
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この機に記載した者は 次に該当する:	
西川 正巳 NISHIKAWA Masami		出願人のみである。	
〒601-8116 日本国京都府京都市南区上鳥羽鉾立	2町11番5		
株式会社 エステック内 c/o STEC INC., 11-5, Kamitobahokodatecho, M	inami ku. Kuata shi	✓ 出願人及び発明者である。	
Kyoto 601-8116 Japan	mami-ku, Kyoto-sin,	発明者のみである。	
		(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)	
	•	出類人登録番号:	
\			
国語 (国名): 日本国 JAPAN 住	·所 <i>(国名)</i> : 日本国 JAPA	'N	
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出所人である: すべての指定国 米国を辞	☆くすべての指定国  ✓ 米国のみ	追記機に記載した指定国	
その他の出願人又は発明者が検集に記載されている。			
第Ⅳ欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名	<u></u>		
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:	✔ 代理人 共通の	の代表者	
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の頃に記載;法人は公式の完全な名称を記載;	あて名は郵便設身及び国名も記載)	和括番号:	
弁理士 藤 本 英 夫 FUJIMOTO Hideo		06-6352-5169	
〒534-0025 日本国大阪府大阪市都島区片町 27	「目 2番40号	ファクシミリ番号:	
大発ビル5階	06-6352-7629		
Daihatsu Building 5th Floor, 2-40, Katamachi 2 Osaka-shi, Osaka 534-0025 Japan	-chome,Miyakojima-ku,	加入 載信 番号:	
Osaka-sili, Osaka Osa-Ouza Japan		代理人基殊曲号:	
		7427	
通知のためのあて名: 代理人又は共通の代表者が選任されておらず 上記於内	に毎に通知が済付されるもでをたねやして	いる場合は「レ印を付す	

様式PCT/RO/101 (第1用紙) (2001年3月版)

7	 
Z	. 21

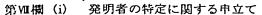
第Ⅲ欄の続き	その他の出	願人又は発明者						
	この統葉を使用しないときは、この用紙を顧書に含めないこと。							
氏名 (名称) 及びあて	名:(姓・名の順	質に記載;法人は公式の完全	な名称を記	載;あて名は郵便番号及	び国名	各も記載)	この欄に 次に該当	記載した者は
山口 正男		GUCHI Masao				, N. V	.	・」・ 「人のみである。
<b>⊤</b> 601-8116	日本国京 株式会社	都府京都市南区. エステック内	上鳥羽	洋立町11番5				1人及び発明者である。
		Kamitobahokod	atecho,	Minami-ku, Ky	yot	o-shi,		•
Kyoto 601-8	116 Japar	ı , '	•				ن سار	者のみである。   こにレ印を付したときは、  下に記入しないこと
			<u>-</u>				出順人登	<b>録</b> 番号:
国籍(国名): 日	本国 J	APAN		住所 (国名): 日	本国	JAPA	AN .	
この欄に記載した者に 指定国についての出稿	1	すべての指定国		]を除くすべての指定国	V	米国のみ		追記欄に記載した指定国
氏名 (名称) 及びあて	名:(姓・名の順	質に記載;法人は公式の完全	な名称を記	数;あて名は郵便番号及	び国4	8.6記載)	この欄に	記載した者は する:
j								人のみである。
								i人及び発明者である。
				•				CARGACAS.
							( <u>-</u>	者のみである。 こに <i>レ印を付したときは、</i>
								(下に記入しないこと)
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			出版人登録	段番号: 
国籍 (国名):				住所 (国名):			· .	
この欄に記載した者は 指定国についての出版		すべての指定国	米国	を除くすべての指定国		米国のみ		追記欄に記載した指定国
		に記載;法人は公式の完全	な名称を記げ	数;あて名は郵便番号及(	び国名	も記載)	この欄に2	記載した者は
								, し . 人のみである <b>。</b>
	,÷.							人及び発明者である。
								人及び鬼明白である。
	:.						( <u>-</u>	者のみである。 こに <i>レ印を付したときは、</i>
-								下に記入しないこと)
						·	出願人登録	录番号:
国籍 (国名):				住所(国名):				
この横に記載した者は 指定国についての出願		すべての指定国	米国	を除くすべての指定国		米国のみ		追記禰に記載した指定国
氏名 (名称) 及びあて	名:(姓・名の順	に記載;法人は公式の完全	な名称を記載	<b>さ;あて名は鄭便番号及び</b>	グ国名	も記載)	この機に割ったに該当っ	已載した者は する:
	, ,						出類	人のみである。
					•		H.186	人及び発明者である。
	1							700 707 B C 07 3.
					٠		<u> </u>	者のみである。 こにレ印を付したときは、 下に記入しないこと)
							出願人登録	录数号:
国籍 (国名):		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		住所 <i>(国名)</i> :			•	
この欄に記載した者は 指定国についての出願		すべての指定国	米国	を除くすべての指定国		米国のみ		追記領に記載した指定国
その他の出願人又	は発明者が他の紀	免薬に記載されている。						
様式PCT/RO/10								

第V欄 国の指定 は当する口にレ申る	と付すこと:少なくとも1つの口にレ印を付すこと)。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	面の保護又は取扱をいずれかの指定国(又は OAPI)で求め	うる場合には追記欄に記載する。
広域特許	ーナ Ghana,GMガンビア Gambia,KEケ=	ZVana I Styllanda
MWマラウイ Malawi, MZモ	ー)Ghana, G IVIDンと)Gambia, K Eゥー ザンビーク Mozambique, S Dスーダン Sudan	- ) Kenya, L S レント Lesotno, , S-L シエラ・レオネ Sierra Leone,
S Zスワジランド Swaziland, T	` スタンザニア United Republic of Tanzania, U	「Gウガンダ Uganda, Z Mザンピア Zambia,
	ハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である他	
□EA ユーラシア特許:AMア	ルメニア Armenia、A 乙アゼルバイジャン Azer	baijan,B Y ベラルーシ Belarus,
	K Zカザフスタン Kazakhstan, MDモルドヴ	
rederation, 1 J タンキスタン T 締約国である他の国	ajikistan,TMトルクメニスタン Turkmenistan	,及びユーラシア特許条約と特許協力条約の
回EP ヨーロッパ特許:ATオ	ーストリア Austria,BEベルギーBelgium,B	BGブルガリア Bulgaria, CH and LI
スイス及びリヒテンシュタイン Swi	tzerland and Liechtenstein, C Yキプロス Cyp nmark,E Eエストニア Estonia,E S スペイ	orus, CZfx=Czech Republic, DEF1
フランス France, G B 英国 Unite	nmark, と ヒェストー) Estonia, ヒ ら スペイ ed Kingdom, G Rギリシャ Greece, I Eアイ	ンSpain, F I フィンラントFinland, F R ルランドIreland, I Tイタリア Italy, L U
ルクセンブルグ Luxembourg, M(	こモナコ Monaco,N L オランダ Netherlands,	P Tポルトガル Portugal, S Eスウェーデン
Sweden, S I スロヴェニア Slove 約の締約国である他の国	enia, S Kスロヴァキア Slovakia, T Rトルコ	<sup>2</sup> Turkey,及びヨーロッパ特許条約と特許協力条
□OA OAPI特許:BFブルキ	テナ・ファソ Burkina Faso, B Jベナン Benin,	
CGコンゴCongo, CIコートシ	·ボアール Côte d'Ivoire, C Mカメルーン Camero a,G Wギニア・ビサオ Guinea-Bissau,M L‐	con, G Aガボン Gabon, G Nギニア Guinea,
E ニジェール Niger, S Nセネガ	ルSenegal,TDチャドChad,TGトーゴTo	go,及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国で
あり特許協力条約の締約国である他の	D国 (他の種類の保護又は取り扱いを求める場合に	は点線上に記載する)
国内特許(他の種類の保護又は取り扱いを)	•	
□ A Eアラブ首長国連邦 United Arab Emirates	□ G E グルジア Georgia □ G H ガーナ Ghana	□ N Zニュー・ジーランド New Zealand
□ A Gアンティグア・バーブーダ	□ G Mガンピア Gambia	□ O Mオマーン Oman
Antigua and Barbuda	□ H Rクロアチア Croatia	□ P Hフィリピン Philippines
□ A L T N N = T Albania		□ P Lポーランド Poland □ P Tポルトガル Portugal
□ AMアルメニア Armenia		□ R Oν-マ=ア Romania
□ A Uオーストラリア Australia	□ I NインドIndia	ロR Uロシア Russian Federation
□ A Zアゼルバイジャン Azerbaijan	□ I Sアイスランド Iceland	□ S Cセイシェル Seychelles
□ B Aボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia	□ J P日本 Japan	□ S Dスーダン Sudan □ S Eスウェーデン Sweden
and Herzegovina	□ K E ケニア Kenya □ K G キルギスタン Kyrgyzstan	□ S G シンガポール Singapore
□ B Bバルバドス Barbados	□ Κ P北朝鮮	□ S Kスロヴァキア Slovakia
□ B Gブルガリア Bulgaria	Democratic People's Republic of Korea	□ S Lシエラ・レオネ Sierra Leone □ T J タジキスタン Tajikistan
□ B Rブラジル Brazil □ B Yベラルーシ Belarus	<ul><li>区 K R 韓国 Republic of Korea</li><li>L K Z カザフスタン Kazakhstan</li></ul>	□ T Mトルクメニスタン Turkmenistan
□ B Zベリーズ Belize	□ L Cセント・ルシア Saint Lucia	
□ C Aカナダ Canada	□ L Kスリ・ランカ Sri Lanka	□ T Nテュニジア Tunisia
□ C Hand L I スイス及びリヒテンシュタイン		□ T R トルコ Turkey
Switzerland and Liechtenstein 区内中国 China	□ L Sレソト Lesotho □ L Tリトアニア Lithuania	Trinidad and Tobago
COPPYET Colombia	□ L Uルクセンブルグ Luxembourg	□ T Zタンザニア
□ C R コスタリカ Costa Rica	□ L Vラトヴィア Latvia	United Republic of Tanzania
□ C U+=-ハ Cuba	□MA∓□ッ□ Morocco	□ U Aウクライナ Ukraine
□ D E ドイツ Germany	□MDモルドヴァ Republic of Moldova	図 U S 米国 United States of America
□ D Kデンマーク Denmark	□MGマダガスカル Madagascar	
□ DMドミニカ Dominica	□MKマケドニア旧ユーゴスラヴィア	□ U Z ウズベキスタン Uzbekistan
□ D Zアルジェリア Algeria □ E Cエクアドル Equador	共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia	ディ・ン諸島 Saint Vincent and the
□ E E = Z \ F = T Estonia	□MNモンゴル Mongolia	Grenadines
ロESスペインSpain	□MWマラウイ Malawi	□ V Nベトナム Viet Nam
□ F I フィンランド Finland	□M X メキシコ Mexico	□ Z A南アフリカ共和国 South Africa
□ G B英国 United Kingdom □ G D グレナダ Grenada	□M Z モザンビーク Mozambique	
C C D / V / 9 Grenada	□ N O ノルウェーNorway	□ Z Mサンヒア Zambia
以下の目は、この様式の塩行後に株数切った。	りの締約国となった国を指定するためのものである。	□ Z Wジンパブエ Zimbabwe
以下の口は、この様式の施门技に特許協力条件	のの権利国となった国を指定するためのものである。	· 
1		
指定の確認の宣言:出願人は、上記の指定に加えて、規	則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる	他の全ての国の指定を行う。但し、追記欄にこの宣言か
	、は、これらの追加される指定が確認を条件としているこ。 で取り下げられたものとみなされることを宜食する。 <i>(指</i>	
び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から		之。····································
様式PCT/RO/101 (第2用紙) (2003年1月	版)	

		4			-
 	 		 	 	Е

第VI欄 優先権主	張					
以下の先の出願に基づ	く優先権を主張する:					
先の出願日	先の出願番号		先の出願			
(日. 月. 年)		国内出願:バリ条約同盟国名又は WTO 加盟国名	広域出願: * 広域官庁名	国際出版: 受理官庁名		
25.03.02	特願 2002-82297	日本国 Japan				
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
他の優先権の主	張(先の出願)が追記欄に	記載されている。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	し、本国際出願の受理官庁に対し 国特許庁の長官)に対して請求す		のものについて、出願書類の	認証謄本を作成し国際事務局へ送付する		
すべて	優先権(1) 優先権	(2) 優先権(3) 優先	権(4) 優先権(5)	- その他は追記欄参照		
		出額を行った工業所有権の保護のためのバ				
第VII欄 国際調査						
国際調査機関 記載。)	(ISA) の選択 (:	2以上の国際調査機関が国際調査を第	<b>実施することが可能な場合</b>	、いずれかを選択し二文字コードを		
ISA/JP				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
先の調査結果の 出願日(日.		査の照会(先の調査が、国際調 出願番号	査機関によって既に実施又 国名(又は広城	•		
第2個 申立て						
この出類は以下の申っ	立てを含む。 <i>(下記の該当</i> :	する欄をチェックし、右にそれぞれの	の申立て数を記載)	申立て数		
ダ 第V皿欄(i)	発明者の特定に関	まままま ままま ままま ままま ままま しょう はんしょう かいしゅう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃ し		: 1		
V 第VII欄(ii)	■ 単類					
第VII欄(iii)	先の出願の優先村 出願人の資格に関	室を主張する国際出願日( 関する申立て	こおける	:		
<b>✓</b> 第Ⅷ欄(iv)	発明者である旨 <i>の</i> (米国を指定国と			1		
第VII欄(v)	不利にならない! て	用示又は新規性喪失の例	外に関する申立	:		

様式PCT/RO/101 (第3用紙) (2002年7月版)



申立ては実施細則第 211 号に規定する保護文書を使用して作成しなければならない。 新聞網と同梱(i)~(c)の偏等の起論部分、及び本質に特育の事項について新聞欄(i)の偏考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を顧客に含めないこと

発明者の特定に関する申立て (規則 4.17(i)及び 51 の 2.1(a)(i))

#### 本国際出願に関し、

〒601-8116 日本国京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番5 株式会社 エステック内 在住の西川 正巳は、本国際出願によって保護を求められている対象の発明者である。 本申立ては、 米国を除くすべての指定国 のためになされたものである。

# 本国際出願に関し、

〒601-8116 日本国京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番5 株式会社 エステック内 在住の山口 正男は、本国際出願によって保護を求められている対象の発明者である。 本申立ては、 米国を除くすべての指定国 のためになされたものである。

この申立ての続葉として「第四欄(i)の続き」がある

<del></del>	6 д	

第四欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て

申立ては実施細則第 212 号に規定する標準文督を使用して作成しなければならない。第個欄と同欄(i)〜(v)の備考の総論部分、及び本頁に特有の事項について第個欄(i)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を顧書に含めないこと。

出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て(規則 4.17(iv)に基づく申立てに該当しない場合)(規則 4.17(ii)及び 51 の 2.1(a)(ii))

本国際出願に関し、

以下の事実により、株式会社エステックは、出願し及び特許を与えられる資格を有している。 2002年1月24日付けで、西川正巳、山口正男と株式会社エステックとの間に締結された契約 本申立ては、米国を除くすべての指定国のためになされたものである。

\_\_\_\_ この申立ての続葉として「第VII欄(ii)の続き」がある

#### 第VII欄(iv) 発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)

中立ては実施細則第 214 号に規定する以下の標準文言を使用して作成しなければならない。第14個と同機(i)へ(v)の偏等の結論部分、及び本質に特有の事項について第14機(iv)の偏等を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を顧書に含めないこと。

#### 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv)及び51 の 2.1(a)(iv)) (米国を相定国とする場合)

私は、特許請求の範囲に記載され、かつ特許が求められている対象に関して、自らが最初、最先かつ唯一の発明者である(発明者が1名しか記載されていない場合)か、あるいは共同発明者である(複数の発明者が記載されている場合)と信じていることを、ここに申し立てる。

本中立ては、本書がその一部をなす国際出版を対象としたものである	(出願時に中立てを提出する場合)。
本中立ては、国際出願 PCT/	を対象としたものである (規則 26 の 3 に従って申立てを提出する場合)。
上記出願の願事において主張する優先権を特定し、かつ、「先の出願」と	解していることを、ここに表明する。私は、PCT 規則 4.10 の規定に従い、 いう見出しの下に、出願番号、国名又は世界貿易機関の加盟国名、出願日、 ている PCT 国際出願を含め、優先権を主張する本出願の出願日よりも前の べて特定している。

先の出願:

私は、連邦規則法典第37編規則1.56 (37 C.F.R. § 1.56) に定義された特許性に関し重要であると知った情報について開示義務があることを、ここに承認する。さらに、一部継続出願である場合、先の出願の日から一部継続出願の PCT 国際出願日までの間に入手可能になった重要な情報について開示義務があることを承認する。

私は、表明された私自身の知識に基づく陳述が真実であり、かつ情報と信念に関する陳述が真実であると信じることをここに申し立てる。さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典第 18 編第 1001 条に基づき、罰金、拘禁、又はその両方により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願又はそれに対して与えられるいかなる特許についても、その有効性を危うくすることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに申し立てる。

氏名:西川 正巳

住所: 京都市 京都府 日本国

(都市名、米国の州名(該当する場合)又は国名)

郵便のあて名: 〒601-8116 日本国京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番5 株式会社エステック内

国籍: 日本国 Japan

8四米の安全・ 近い 正 じ

(国際出願の願事に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に中立ての補充や追加がなされた場合。署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。)

日付: 28.02.03

(国際出願の顧審に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合)

**止**。山口 正男

<sub>住所:</sub> 京都市 京都府 日本国

------(都市名、米国の州名(該当する場合)又は国名)

郵便のあて名: 〒601-8116 日本国京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番5 株式会社エステック内

<sub>国籍:</sub> 日本国 Japan

如来08名: 山口正史

(国際出願の願事に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づい て国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合。署名は代 理人ではなく、発明者のものでなければならない。) 日付: 28.02.03

(国際出願の顧客に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に中立ての補充や追加がなされた場合)

この申立ての続葉として「第Va欄(iv)の続き」がある

	8			'n

第1X欄 照合欄;出願の言語	·
この国際出版は次のものを含む。 (a) 紙形式での枚数  和書(中立てを含む) 8 枚	この国際出版には、以下にチェックしたものが添付されている。 数 1. V 手数料計算用紙 7
明細書(配列表または配列表 に関連する表を除く)… 10 枚	が 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面 1
請求の範囲・・・・・・・・・・・ 1 枚	☑ 国際事務局の口座への扱込を証明する書面 : 1
要約4 1 技	2. 🗸 個別の委任状の原本 :
図面 5 技	3. 包括委任状の原本
小計 25 枚	4. 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号)
在列表····································	5. 記名押印 (署名) の欠落についての説明書
	6. (仮先権書類(上記第 機の( )の番号を記載する):
コンピュータ設み取り可能な形式の有無を問わない。 下記(C)を所) 合計 25 枚	7. 国際出版の翻訳文(翻訳に使用した音語名を記載する): : :
	8.   新託した微生物又は他の生物材料に関する書面
(b) コンピュータ飲み取り可能な形式のみの (実施細則第 801 号(a)(i))	9. コンピュータ読み取り可能な配列表 (収体の極質と枚数も表示する)
. / (i)	(i) 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のためのひし (国際出席の一部を構成しない)
(C) コンピュータ餃み取り可能な形式と同一の	(ii) (左関(ら)(i)又は(C)(i)にレ印を付した場合のみ) 以則 13 の 3 に基づき契出する国際調査のためのびしを含む追加的びし :
(実施細則第 801 号(a)(ii)) (i) 配列表	(iii) 国際異義のための写しの同一性、又は左側に記載した配列及を含む写しの同一性についての様述書を指付 :
(ii) 配列表に関連する表	10. コンピュータ統み取り可能な配列表に関連する表 (技体の種類と枚数も表示する) :
媒体の種類 (スレキシプメテ゚ィスタ、CD-ROM、CD-R、その他) と枚数	(I) (国際出版の一部を構成しない) (
記列表	(ii) 実験細胞系 802 りもの 4 に基づき製出する国際調査のためのなしを含む追加的なし :
(追加的写しは右攔9. (ii)または 10(ii)に記載)	****/
要約事とともに提示する図面: 第1図	本国際出願の言語: 日本語
第X欄 出願人、代理人又は共通の代 き人の氏名(名称)を配載し、その次に押印する。	表者の記名押印
藤本英夫消费	
「四郎山城し」で明山とわる李統の中部の東部の日	
1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日	受理官庁記入捌
3. 国際出版として提出された者類を補完する書面又は図 その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(紅	·
   4.特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期 	間内の受理の日
5. 出版人により特定された 国際調査機関 ISA/	6. 四弦手数料未払いにつき、国際調査機関に 調査用写しを送付していない。
記録原本の受理の日:	国際事務局記入欄

この用紙は、国際出願の一郎を構	は成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない。	
P C T		宁記入欄
手数料計算用紙	国際出願番号	
出願人又は代理人の各項記号 FP165S	受理官庁の日付印	
出版人 株式会社エステック		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
所定の手数料の計算		
<ol> <li>及び2. 特許協力条約に基づく国際出願に関する法律(国内法) 第18条第1項第1号の規定による手数料(注1) (送付手数料[T]及び調査手数料[S]の合計)</li> </ol>	90000 म т+ѕ	
3. 国際手数科 <i>(注2)</i> 		·
bl 最初の30枚まで 5	54000 円 ы	
b2   ×	<b>Р b</b> 2	
b3   の場合 (第 801 号(a)(i)) 又はコンピュータ終み取り可能な形式と   紙形式の両方である場合 (第 801 号(a)(ii))   400 × =	<b>Р</b> b3	
用紙一枚の手数料 b1, b2 及び b3 に記入した金額を加算し、合計額を B に記入	54000 PI B	
指定手数料 国際出願に含まれる指定数 4		
4     ×     11600     =       1支払うべき指定手数料     1指定当たりの手数料       の数 (上限は5)(注4)     (円)	46400 A D	
B 及び D に記入した金額を加算し、合計額を I に記入	100400 円 1	
4. 納付すべき手数料の合計		
T+S 及び!に記入した金額を加算し、総額を合計に記入	190400 🖪	

- (注1) 送付手数料及び調査手数料については、合計金額を特許印紙をもって納付しなければならない。
- (注2) 国際手数科については、受理官庁である日本国特許庁の長官が告示する国際事務局の口座へ仮込みを延明する書面 を提出することにより納付しなければならない。
- (注3) 顧書第V欄でレ印を記した口の数。
- (注4) 指定数を記入する。ただし、5 指定以上は一体5 とする。

様式PCT/RO/101 (付属書) (2002年1月版)







送付手数料

調査手数料

合 計

1.8, 000円

72,000円

90,000円

ご利用明細

こ来店いただきありかとうこざいます。

@ 東京三菱銀行

	ľ			I
		_	-	-
l.				ı
			*	ж
	ij		١	
•			_	_

	ありか	とうこ	さいます	<b>f.</b>		-117.	. `	PC 353X 1	3
	年月	3		店番			3取引ア	容	7
	1503	317	52	7165	₹ <b>8</b> 10	1 #	法振步	ĺ.	
	銀行茬	号3	吃番号	口座番	号 号				1
	1			]		200		SUS-SEC	5
									7
	1	***	* * * *	****	***	***	***	****	
	お取ら							<del></del>	Η
	l					3	∉1nn	400	.
	お取扱い	1.128合	残高				100	, 400	7
									1
	時刻14	1:3	5 校込手;	14 ¥31	5 × 3	פכי	¥Ο	285	$\exists$
8	#		菱銀				- ' -	200,	4
お振込先	虎ノ	PF :	支店		٠.				1
荒	曾 诵	20	748	96					
5	VIPO	)-P	CT G	ĒNEVA	維		N		
춫					191				
Ž	フシェチ	<b>h h</b>	ッキョ	ENEVA ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚	ia -7:	1 * Ŧ k	. F7'	* # #	1
_		•	, , _	4 -	_ /.	, L,	۲,	אגר ר	ł
Š	663	525	5169						
ř									4
^									13
									1/,
4									1

基本手数料

54,000円

指定手数料

46,400円

合 計

100,400円

. ` . <u>.</u> '



# 委任状

2003年 2月28日

私儀 弁理士 藤本 英夫を代理人と定めて、下記の権限を委任します。

- 特許協力条約に基づく国際出願「マスフローコントローラ」 に関する一切の件
- 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件
- 3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに請求及び選択国の選択を取下ける件

あて名 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番5

株式会社 エステック内

代表者 西

西川 正巳



あて名 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番5

株式会社 エステック内

代表者 山口 正男

# 優先権証明願 (PCT)

# 特許庁長官 殿

- 1. 出願番号 特願 2002- 82297
- 2. 請 求 人

住 所 〒601-8510 日本国京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

名 称 株式会社 エステック

代表者 堀場 厚

- 3. 出願国名 PCT
- 4. 代 理 人

住 所 〒534-0025 日本国大阪府大阪市都島区片町2丁目2番40号

大発ビル5階

氏 名 (7427)弁理士 藤 本 英









(1, 400円)

#### 明細書

マスフローコントローラ

# 技術分野

この発明は、マスフローコントローラに関する。より詳細には、圧力影 5 響を受けないマスフローコントローラに関するものである。

# 背景技術 `

第4図は、従来のマスフローコントローラを用いた半導体製造ライン10の例を示す図である。第4図において、11,12は2系統の半導体製10造ラインを構成するチャンバ、13a~13dはチャンバ11,12に異なるガス $G_1$ , $G_2$ を供給するガス供給ライン、14,15は各ガス $G_1$ , $G_2$ をそれぞれ供給するガスボンベである。

各ガス供給ライン13a~13dは、何れも、機械式の調圧器16a~16dと、この調圧器16a~16dの下流側のゲージ17a~17dと 、マスフローコントローラ18a~18dとを設けてなる。また、19a~19dはフィルタである。ガス供給ライン13a, 13cはガスG, をそれぞれチャンバ11, 12に供給し、ガス供給ライン13b, 13dはガスG。をそれぞれチャンバ11, 12に供給するものである。つまり、複数のガスG1, G2を複数ライン13a~13dに供給するものである 20。

前記ボンベ14,15から供給されるガス $G_1$ , $G_2$ の圧力は、その出口側で通常98kPa程度に減圧されているが、この圧力を前記調圧器1 $6a\sim16$ dによって例えば30kPa程度に減圧してマスフローコントローラ18 $a\sim18$ dに供給することで、マスフローコントローラ18a

~18dの破損を防いでいる。また、半導体製造ラインの管理者はチャンバ11,12に所定流量のガス $G_1$ , $G_2$ を流すようにマスフローコントローラ18a~18dを制御し、ゲージ17a~17dを確認しながら調圧器16a~16dを調節することによりマスフローコントローラ18a5~18dに供給するガス $G_1$ , $G_2$ の圧力を適宜調整する。

第4図に示すように、マスフローコントローラ18a~18dを調圧器 16a~16dと組み合わせることにより、ガスG1, G2の供給側のある程度の圧力変動が発生しても安定した制御を行うことを可能としている。 しかしながら、前記従来のマスフローコントローラ18a~18dと 調圧器16a~16dとの組み合わせを形成するためには、複数の部材16a~16d, 17a~17d, 18a~18d, 19a~19dを連通連結する必要があるので、ガス供給ライン13a~13dの設置に手間とコストがかかることは避けられなかった。また各部材16a~16d, 17a~17d, 18a~18d, 19a~19d間を接続する配管の数が 多ければ多いほど接続部においてガス漏れなどの問題が発生するリスクが高くなるだけでなく、配管によって生じる抵抗が流量に限界や不安定要素をもたらすこともあった。

そして、前述のマスフローコントローラ18a~18dと調圧器16a~16dとの組み合わせによる流量制御だけでは、流量の大幅な変更に伴ってマスフローコントローラ18a~18d内の流量制御装置の入口側の圧力や出口側の圧力が変動して、安定した流量制御が行えない場合があった。

つまり、機械式の調圧器 1 6 a ~ 1 6 d はある程度流量が安定しているときには圧力を適正に調整することが可能であるが、流量が急激に変化するときにはこれに対応できないことがあり、マスフローコントローラ 1 8 a ~ 1 8 d による流量の急峻な制御によって生じる入口側における圧力変

動が、マスフローコントローラ18a~18dによる流量の安定制御に支障をもたらす場合があった。

また、ガス供給ライン13aによって供給するガス流量の急激な変化が、調圧器16aの上流側の圧力に影響を与えることもあり、これに分岐接5 続されている別のガス供給ライン13cによって供給するガスの流量にも乱れを生じさせることも考えられる。

さらに、第5図に示すように、コストダウンを目的として1台の調圧器 16a, 16bから配管を分岐接続して、複数台のマスフローコントロー ラ18a~18dを制御することも行われているが、この場合は、前記圧 10 力変動による影響が大きくなるという問題があった。

本発明は、上述の事柄を考慮に入れてなされたもので、その目的は、マスローコントローラの上流側および下流側の何れにおいて圧力変動が発生しても、目的とする流量を常に安定して流すことができるマスフローコントローラを提供することにある。

. 15

# 発明の開示

上記目的を達成するため、本発明のマスフローコントローラは流量制御 弁と流量センサとを有するマスフローコントローラであって、流量制御弁 の上流側に配置された圧力制御弁と、この圧力制御弁と流量制御弁の間に 20 配置された圧力センサと、この圧力センサの出力をフィードバックするこ とで圧力制御弁を制御する制御部とを有することを特徴としている。

したがって、このマスフローコントローラを用いることにより、その上流側において圧力変動が発生しても、圧力センサの出力によってフィードバック制御された圧力制御弁によってその影響を確実に除去できると共に、マスフローコントローラの下流側において生じる圧力変動は、流量センサの出力によってフィードバック制御された流量制御弁によって確実に除

去することができる。

すなわち、マスローコントローラの上流側および下流側の何れにおいて 圧力変動が発生しても常に安定した流量の制御を行なうことができる。言 い換えるなら、マスフローコントローラ内に圧力調整機能があるので、流 5 量制御弁の入口側圧力を常に一定に保つことが可能であり、その性能を最 大限に引き出すことが可能となる。ゆえに、流量精度および安定性も向上 する。

また、安定した流量のガスを供給するために従来のように機械式の調圧 器を用いる必要がないので、ガス供給ラインの構成を簡素にすることがで き、それだけ、ガス供給ラインの構築にかかるコストを削減することがで きる。加えて、複数の部材を連通連結する必要がないので、不要な配管流 路や接続部の形成に伴うガス漏れ発生の虞れや、流路抵抗による減圧の発 生を無くすことができる。

前記圧力センサを流量センサの直前の流路に臨ませてなる場合には、マスフローコントローラ内で必要とされる流路に圧力センサを臨ませているので、マスフローコントローラをコンパクト化することができると共に、流量センサの直前の流路に圧力センサを設けているので、この流量センサを用いたフィードバック制御によって、より安定した流量制御を可能としている。

20

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明のマスフローコントローラの一例を示すプロック図である。

第2図は前記マスフローコントローラを用いた流量制御の実測例を示す 25 図である。

第3図は前記マスフローコントローラを用いた半導体製造ラインの例を

示す図である。

第4図は従来のマスフローコントローラを用いた半導体製造ラインの例 を示す図である。

第5図は前記従来のマスフローコントローラを用いた半導体製造ライン 5 の別の例を示す図である。

# 発明を実施するための最良の形態

第1図は本発明のマスフローコントローラ1の一例を示すプロック図である。本例のマスフローコントローラ1は流体(以下の例では流体として10 ガスを例示するが、この流体が気体であることを限定するものではない)を流すための流路2を形成する流路プロック3と、この流路プロック3に連結された圧力制御弁4と、流量センサ5と、流量制御弁6と、2つの圧力センサ7と、各部4~6を制御する制御部8と、フィルタ9とを有している。

前記流路2は例えば、流路ブロック3内をくり抜くように形成されており、第1~第3流路2a~2cからなる。また、第1流路2aの上流端および第3流路2cの下流端には配管取付け部3a,3bをそれぞれ設けている。なお、流路2の形成手順は掘削であっても、鋳型を用いたものであってもその他の方法であってもよく、第2流路2bを掘削などで形成する
 場合には流路ブロック3は少なくとも1か所において分離可能に形成する必要があるが、何れにしても流路ブロック3,3a,3bを全体的に一体成形することで、ガス漏れを防ぐことができる。

圧力制御弁4は例えば流路プロック3の一側面に形成された弁座3cに 当接するダイアフラム4aとそのアクチュエータ4bとからなり、制御信 25号Cpによって前記流路2a,2bを連通連結する開度が制御可能に構成 される。 流量センサ 5 は例えば第 2 流路 2 b内に挿入された整流体 5 a 2 、この第 2 流路 2 bから所定の割合 1 1 Aの流量だけ分岐する分岐流路 5 b 2 、この分岐流路 2 b に設けたセンサ本体 2 c 2 を有し、総流量 2 を示す流路信号 2 f を出力する。

また、流量制御弁6は例えば流路プロック3の一側面に形成された弁座3dに当接するダイアフラム6aとそのアクチュエータ6bとからなり、制御信号Cfによって前記流路2b,2cを連通連結する開度が制御可能に構成される。

前記圧力制御弁4,流量センサ5,流量制御弁6は流路プロック3の一10 側面(上面)に並べて配置されており、これによってマスフローコントローラ1の全体的な大きさを小さく抑えることができる。

前記圧力センサ7は第1流路2aに臨ませるように側面に配置された第1センサ7aと、第2流路2bに臨ませるように側面に配置された第2センサ7bとからなり、両圧力センサ7a,7bは前記各部4~5を取り付けた側面とは異なる面(本例では第1図において第1流路2aの手前および前記流量センサ5を構成する整流体5aの直前に位置する第2流路の奥)にそれぞれ埋設している。これによって、マスフローコントローラ1の全体的な大きさを変えることなく圧力センサ7を設置できる。そして、前記センサ7a,7bはそれぞれ第1流路2a,第2流路2b内の圧力P1

20 , Pcを示す圧力信号Spa, Spbを出力する。

なお、本例ではセンサ7a,7bの側面に設ける例を示しているが、圧力センサ7は流路2に臨ませるように取り付けられるものであれば、その取付け面を限定するものではない。つまり、流路ブロック3の下面に埋設しても、上面で前記制御弁4,流量センサ5,流量制御弁6の邪魔にならない位置に埋設してもよいことはいうまでもない。

前記制御部8は例えば前記圧力センサ7からの圧力信号Spa, Spb

(出力)をフィードバックして圧力制御信号Cpを出力することで圧力制御弁4をフィードバック制御する制御部8aと、流量センサ5からの流量信号Sfをフィードバックして流量制御信号Cfを出力することで流量制御弁6をフィードバック制御する制御部8bと、外部とのインターフェース8cとからなる。そして、制御部8aは外部からの信号に従って流量制御弁6をフィードバック制御すると共に、制御部8aに制御信号を出力して整流体5aの直前における圧力Pcが所定圧となるように制御させる。

また、図示を省略するが制御部8は流量下および一時圧力Pcの設定値や、各センサ5,7a,7bによって測定された値P,,Pc,Fを表示10 する表示部を有している。さらに、センサ5,7a,7bによって測定された値P,,Pc,Fは何れもインターフェース8cを介して外部に出力可能としている。なお、インターフェース8cはデジタル的に通信するものであっても、アナログ的な値の入出力部であってもよい。

さらに、本例では制御関係を明示するために、制御部8a,8bを分け 15 て表示しているが本発明はこの点に限定するものではなく、一つの制御部 8によって全てを一括して制御して、製造コストを引き下げるようにして もよいことはいうまでもない。

加えて、制御部8bによる圧力制御弁4の制御は圧力センサ7bの出力信号Spbだけを用いてフィードバック制御するものに限られるものでは20なく、圧力センサ7aの出力信号Spaも用いて制御してもよい。なお、本例に示すように圧力センサ7aを設けることにより、マスフローコントローラ1に入力されているガスの圧力をモニタすることも可能であるが、この圧力センサ7aを省略してもよいことはいうまでもない。

前記本発明のマスフローコントローラ1は、制御部8bが圧力制御弁4 25 を圧力センサ7bからの圧力信号Spbを用いて指定の圧力Pcになるようにフィードバック制御するので、たとえマスフローコントローラ1の入 口側の圧力P」が何らかの影響によって変動することがあっても、マスフローコントローラ1は安定した制御を行なうことができる。また、制御部8aが流量制御弁6を流量センサ5からの流量信号Sfを用いて測定された流量Fが設定流量Fsになるようにフィードバック制御しているので、マスフローコントローラ1の出口側の圧力P2が変動してもその影響を受けることがない。

したがって、本発明のマスフローコントローラ1はその前段に従来のような調圧器16a~16dを設ける必要が全くなくなる。また、本例のマスフローコントローラ1はフィルタ9も内蔵しているので、従来のように10別途のフィルタ19a~19dを連通連結する必要もない。すなわち、それだけガス供給ラインの簡素化を図ることができ、設置面積を少なくすることができる。なお、本例ではフィルタ9を流路2の再上流端に設ける例を示しているが、本発明はフィルタ9の位置を限定するものではない。また、場合によってはフィルタ9を省略することも可能である。

- 15 特に、本例に示すように、一体化した流路ブロック3内において、流量センサ5の直前の流路2bに圧力センサ7bを臨ませて、この圧力センサ7bの圧力信号Spbを用いて所定の圧力Pcを保たせるように構成しているので、流量センサ5がこの圧力Pcを一定にした状態における流量Fをより正確に測定することができる。
- 20 また、本例に示すように、圧力制御弁4と流量センサ5を並べて配置し、その間に位置する第2流路2bをできるだけ短くしているので、圧力制御弁4の開度制御信号Cpの出力に対する圧力Pcの時間的な遅れを可及的に小さくし、流量センサ5の部分における圧力Pcの変動をできるだけ小さくできる。
- 25 さらに、前記圧力センサ7bを圧力制御弁4と流量センサ5の間における第2流路2bにおいてできるだけ流量センサ5に近い位置(直前を構成

する流路) に配置することにより、乱流などの影響の少ない圧力 P c を測定することができる。すなわち、それだけマスフローコントローラ 1 による流量の制御精度および安定性を向上できる。

加えて、前記圧力制御弁4と流量センサ5の間における第2流路2b内 5 から、継手や配管を排除することで、流路の抵抗による圧力低下やガス漏 れリスクを無くすことができる。

第2図は本発明のマスフローコントローラ1の上流側における圧力P」と、下流側における圧力P2を変動させたときにおける、流量の設定値Fと、流量センサ5の出力信号Sfから求められる流量Fと、各制御信号Cp, Cfとを実測した例を示している。

第2図において、横軸は時間(秒)を示しており、約5秒毎に圧力 $P_1$ 、 $P_2$ をランダムに変動させており、本例では例えば上流側の圧力 $P_1$ を 200±50kPaの範囲で急激に変動させており、下流側の圧力 $P_2$ を 0~3.8kPaの範囲で急激に変動させている。

15 第2図に示すように、前記制御信号Cpはマスフローコントローラ1の上流側の圧力P」の変動に追従して変化しており、これによって前記圧力センサ7bを設けた第2流路2bにおける圧力Fcを一定に保っていることが分かる。また、制御信号Cfはマスフローコントローラ1の下流側の圧力P。の変動に追従して変化しており、これによって流量センサ5に流20 れる流量Fを一定に保っている。

ここで、実際に流れた流量Fと流量の設定値Fsとの比較を行うと、実際に流れた流量Fは、前記圧力P」, P₂の急激な変化が生じている時点において、それぞれ僅かに変動しているが、その変動幅は極く僅かであり、かつ、極く短い時間で直ぐに設定値Fsになっていることが分かる。

25 つまり、本発明のマスフローコントローラ1を用いることにより、上流側の圧力P」および下流側の圧力P2の何れにおいて、急激な圧力変動が

発生したとしても、常に極めて安定した制御で所定流量を流し続けることができることが分かる。

第3図は前記マスフローコントローラ1を用いて第4図に示した従来と同じ構成の半導体製造ラインを形成する例を示している。第3図において 5 第4図と同じ符号を付した部分は同一の部分であるから、その詳細な説明 を省略する。

第3図において、1a~1dはそれぞれ本発明のマスフローコントローラ1である。つまり、本発明のマスフローコントローラ1を用いることにより、前記ガス供給ライン13a~13dは何れも極めて簡素に構成でき 、それだけガス供給ライン13a~13dの構築にかかる手間を削減できることが分かる。また、ガス供給ライン13a~13dの設置面積が小さくなる。

# 産業上の利用の可能性

15 また、各ガス供給ライン  $13a\sim13$  dに生じる配管の連通連結部 が極めて少なくなるので、それだけガス漏れなどのリスクを小さくすることができる。

以上説明したように本発明は、上流側および下流側の圧力変動の影響を 受けることなく確実な動作で高精度の流量制御を行うことができる。また 20 、マスフローコントローラの前段に別途の調圧器を設ける必要がないので 、それだけコストパフォーマンスを向上できる。

# 請求の範囲

1. 流量制御弁と流量センサとを有するマスフローコントローラであって

流量制御弁の上流側に配置された圧力制御弁と、 この圧力制御弁と流量制御弁の間に配置された圧力センサと、

- 5 この圧力センサの出力をフィードバックすることで圧力制御弁を制御する制御部とを有することを特徴とするマスフローコントローラ。
  - 2. 前記圧力センサを流量センサの直前の流路に臨ませてなる請求の範囲 第1項に記載のマスフローコントローラ。

10

15

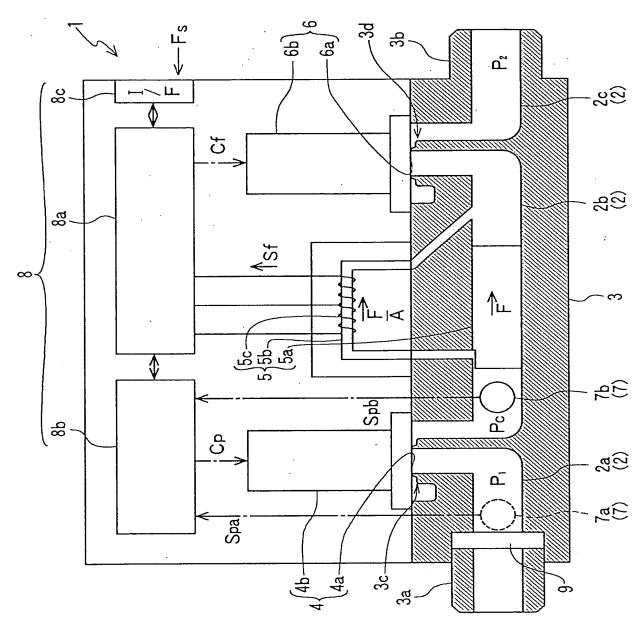
20

### 要約書

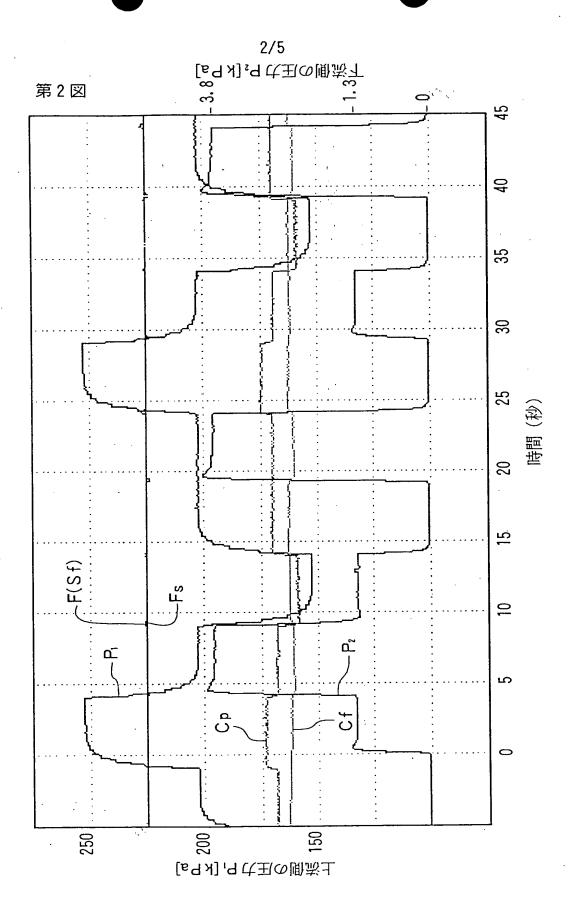
本発明は、マスローコントローラの上流側および下流側の何れにおいて 圧力変動が発生しても、目的とする流量を常に安定して流すことができる マスフローコントローラを提供する。

本発明は、流量制御弁と流量センサとを有するマスフローコントローラであって、流量制御弁の上流側に配置された圧力制御弁と、この圧力制御弁と流量制御弁の間に配置された圧力センサと、この圧力センサの出力をフィードバックすることで圧力制御弁を制御する制御部とを有する。

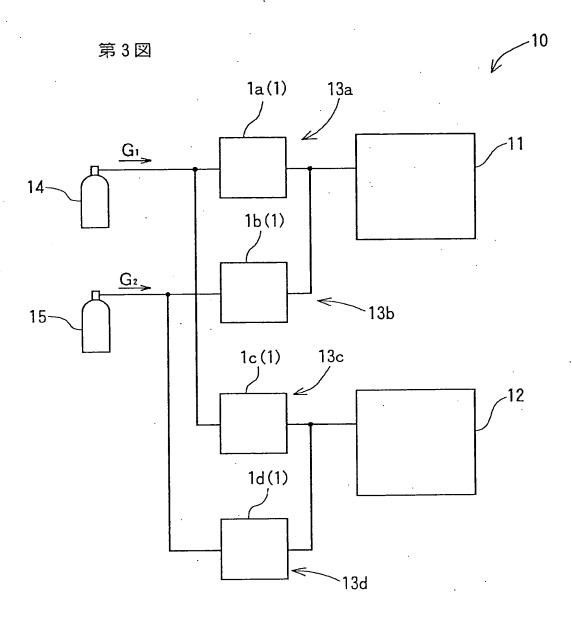
第1図



٠.

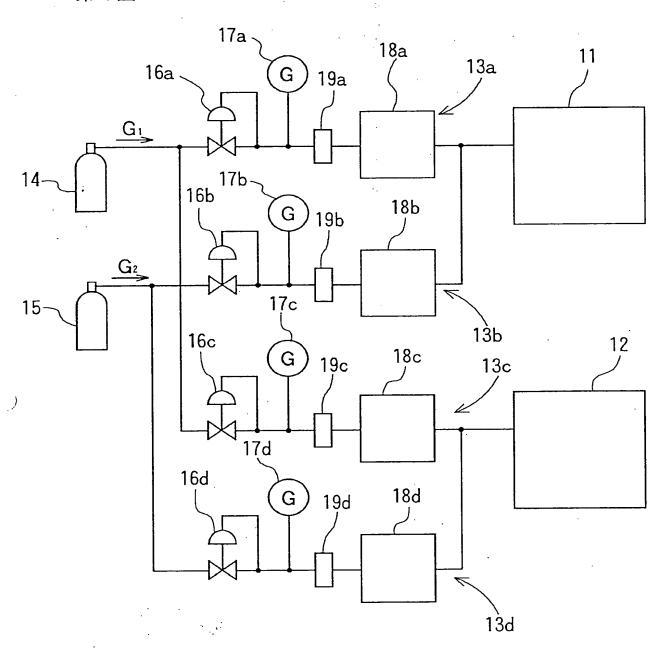


: (\*\*\* (\*\*\*)



,

第4図



第5図

